

# КОНТАКТНІ ЯВИЩА У МІКРОЕЛЕКТРОННИХ СТРУКТУРАХ МЕТАЛ-НАПІВПРОВІДНИК

доц. Однодворець Л.В.,  
маг. Кипарис В.Є., студ. Любивий І.О.

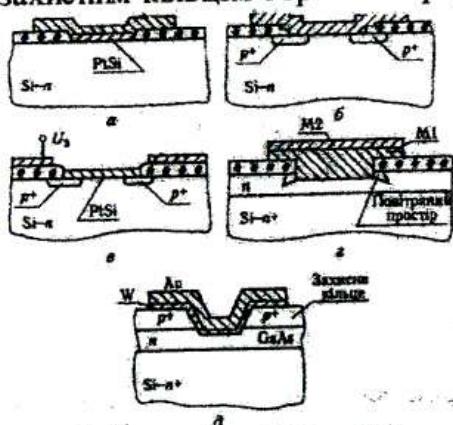
На основі фізичних властивостей контактів метал - напівпровідник засновані принципи дії більшості мікроелектронних елементів. На межі поділу між напівпровідником та металом виникають потенціальні бар'єри, що є наслідком перерозподілу концентрацій рухомих носіїв заряду між контактуючими матеріалами. На основі випрямних переходів формують біполярні діоди та транзистори, тунельні діоди, діоди Шотткі та інші пристрії. Широке застосування випрямні переходи знаходять як ізольуючі елементи в мікроелектронних пристроях та інтегральних мікросхемах (ІМС).

Випрямний контакт Мет-НП - бар'єр Шотткі (БШ), історично був основою одного з перших напівпровідникових випрямних діодів, який використовувався в детекторних радіоприймачах для детектування високочастотного сигналу. Завдяки досягненням сучасної технології відновилась зацікавленість виробників ІМС у використанні бар'єру Шотткі як завершеного конструктивно виділеного елемента ІМС.

Перехід від металевого контакту до НП і є інтегрованим діодом Шотткі (ДШ), структуру якого формують за планарно-епітаксійною технологією із заглибленим  $n^+$ -шаром. ДШ функціонує на основних носіях - електронах, в наслідок чого в kontaktі Мет-НП немає дифузійної ємності, що стримує швидкодію, завдяки цьому вони можуть працювати на частотах до 100 ГГц. У зв'язку зі швидким розвитком технології ІМС створено діоди Шотткі з практично ідеальними характеристиками. Проте раніше в ІМС застосування ДШ стримувалось. Це було пов'язано з тим, що за зворотного зміщення напруга пробою була

менша, ніж напруга р-п-переходів, що спричиняло крайові ефекти (рис. а), для уникнення яких були розроблені конструкції ДШ з розширеною металізацією. Подальше удосконалення конструкцій ДШ привело до створення навколо контакту Me-NP захисного кільца р-типу (рис. б). Напруга пробою збільшилась від 5 до 27 В. Її збільшенню сприяють конструкції з використанням захисного кільця і додаткового електрода (рис. в), на який подають від'ємну напругу. В таких структурах напруга пробою близька до напруги пробою р-п-переходу. Потім були розроблені ДШ із захисним кільцем і трьома бар'єрами, з двома захисними

кільцями та ін. Основним недоліком таких конструкцій є зменшення швидкості перемикання, яке спричиняє інжекція неосновних носіїв заряду із р-кільця, збільшення ємності діода, ускладнення технологічних процесів.



Структура ДШ (рис. г) не має перелічених недоліків. Контакт металу з напівпровідником здійснюється в спеціальному заглибленні в шарі п-типу. Для таких конструкцій діодів висота потенціального бар'єра  $U_{mn}$  зменшується, зменшується бар'єрна ємність  $C_{щ}$  і опір  $r_s$ . Два різних матеріали, які використовуються для створення контакту, забезпечують термостабільність параметрів ДШ. Основний матеріал ДШ – GaAs.

1. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники. Москва: Лаборатория базовых знаний, 2000. – 188 с.
2. Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамола О.Є. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування. - Львів: Новий світ, 2003. - 128 с.